

ポスターセッションのお知らせ

日時：10月30日(木) 16:00-17:00

場所：東工大百年記念館 3F フェライト会議室前 ロビー

製品紹介

1. PEGASUS (プロセスプラズマ/希薄気体シミュレーションツール)
ペガサスソフトウェア(株) 田中 正明
2. 詳細化学反応解析支援ソフトウェア『CHEMKIN』のご紹介
(株)菱化システム 野口 真保
3. 流体ベースのプラズマ解析コード"CFD-ACE+ Plasma"と粒子法ベースの希薄流体解析
コード "Particle PLUS", "DSMC-Neutrals"の御紹介
(株)ウェーブフロント 渡辺 庸一

研究開発紹介

4. プラスチックフィルム基板上への微結晶シリコン太陽電池の高速製膜
富士電機アドバンステクノロジー(株) 大瀬 直之
5. マイクロ波励起 RLSA プラズマによる高品質 TEOS-SiO₂ 膜の成膜
東京エレクトロン技術研究所(株) 大澤 佑介
6. 低環境負荷 PFC 除去装置用円筒状 ICP プラズマ源の開発
太陽日酸(株) 鈴木 克昌
7. 大気圧プラズマ処理によるアミノ化ポリオレフィン粉末の作製とそのポリマーブレン
ドへの応用 九州産業大学 古賀 啓子
8. 大気圧ダメージフリープラズマ源の開発と表面処理への応用
東京工業大学 (ポストドクター) 宮原 秀一
9. プラズマ CVD を用いた基板内微細溝へのカーボン薄膜の製膜
九州大学 (修士2年) 梅津 潤
10. ECR プラズマ源を用いた AlN トンネルバリアの生成
東京大学 (博士3年) 遠藤 光
11. 希ガス希釈 O₂ プラズマを使用したシリコン酸化膜の形成
防衛大学校 北嶋 武
12. プラズマプロセス制御に向けた統合的診断システムの開発
産業技術総合研究所 布村 正太